

Sonderanlagen für die Vakuumbeschichtung CREAMET® und CREAETCH

Sonderanlagen der Marken CREAMET® und CREAETCH bieten Möglichkeiten zur Vakuumbeschichtung mit unterschiedlichsten Schichtsystemen und Verdampfungs- bzw. Plasmaeinrichtungen. Die Anlagen sind nach Kundenwunsch konfigurierbar.



Vakuumtechnologien

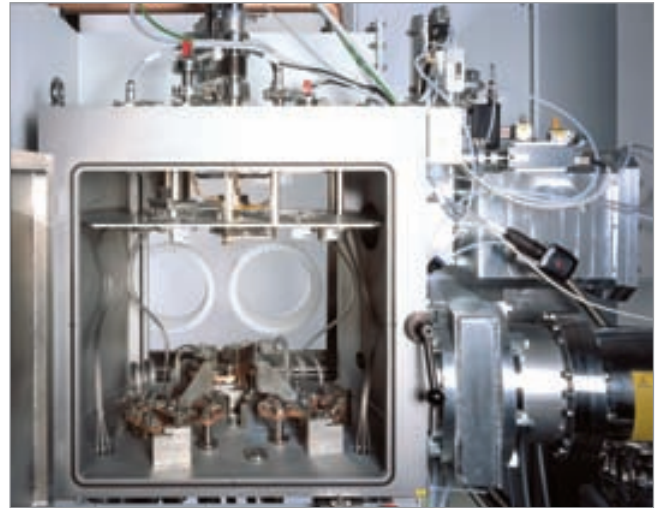
- thermisches Verdampfen
- Sputtern
- Elektronenstrahlverdampfen
- Lichtbogenverdampfen
- CVD-Prozesse
- Plasma-Prozesse
- Temper-Prozesse

Materialien

- reine Metalle und Legierungen (z.B. Ag, Al, Au, Cu, Ni/Cr, Cu/Be)
- organische und anorganische Verbindungen (z.B. ITO, Al₂O₃, SiO, MgF, HMDS)

CREAMET® 500 BC 12 OLED

- Hochvakuumanlage integriert in eine Glovebox
- Zweikammersystem – Plasmaaktivierungs- und Beschichtungskammer
- automatischer Substrattransport
- 12 thermische Verdampfer, einzeln regelbar
- Maskensystem mit Wechselstationen im Vakuum



CREAMET® 400 HAu

- Vakuumkammer mit Glasabdeckung
- Tischgerät mit Arbeitsfläche
- Substratkühlung
- thermische Bedampfung mit in-situ Schichtdickenkontrolle
- Beschichtungssystem mit x-y-Positionierung (Genauigkeit <math><0,1\text{mm}</math>)



CREAMET® 500 BCH

- Produktionsanlage zum Hochvakuumtempern von Quarzen, Wafern, Metallen und anderen Substraten
- bis 400 °C vor und nach dem Beschichten
- Infrarot-Strahlersystem, 8x 400 W Leistung (Blendensystem vergoldet zur erhöhten IR-Reflexion)
- Temperaturfühler kaskadiert geregelt
- drehbares Substralthaltersystem
- Kühlsystem in Kammer integrierbar



CREAMET® 900 E

- wassergekühlte Edelstahlkammer
- Präzisionsmetallisierung
- 3"- und 4"-Waferbeschichtung mit zwei Elektronenstrahlverdampfern
- Wafer-Schichtdickenhomogenität <0,5%
- integrierter aktiver Schichtdickensensor für große Schichthomogenität
- Kryopumpstand



CREAETCH 250 TWIN

- Plasmaätzanalge
- Doppelkammer aus implosionssicheren Glasglocken mit Abschirmgehäuse
- chemikalienresistenter Hochvakuum-Pumpstand
- kostengünstig durch gemeinsamen Pumpstand und Plasmagenerator
- Einzelwaferätzen mit definierten Ätzprofilen



CREAETCH 250 Plasma MV

- Plasmaaktivierungskammer mit Mikrowellen-Quelle
- Tischgerät mit integrierter Vorvakuumpumpe
- CVD-Prozesse integrierbar



CREAVAC

Creative Vakuumbeschichtung GmbH · Löbtauer Straße 65 – 71 · D-01159 Dresden · Germany
Phone +49(0)351 21838 - 0 · Fax +49(0)351 21838 - 19 · e-mail: info@creavac.de · www.creavac.de